

装置管理システムマニュアル

Equipment System Manual

物質・材料研究機構

材料創製・評価プラットフォーム 電子顕微鏡ユニット

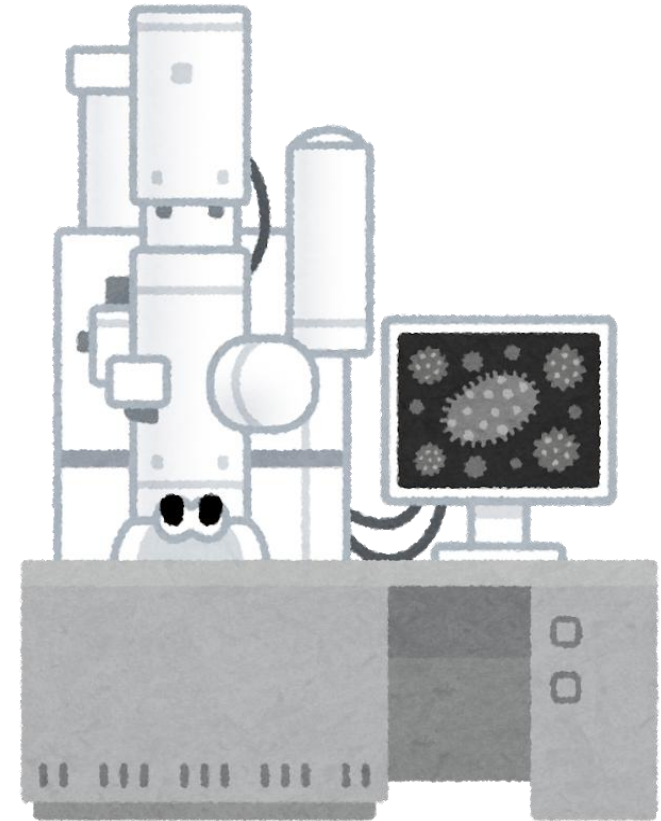
NIMS Materials Fabrication and Analysis Platform,

Electron Microscopy Unit

目次

Contents

- ユーザー登録(内部利用) 2~3
User Registration (Internal)
- 利用申請(内部利用) 4~9
Application for use (Internal)
- 装置の予約 10~13
Equipment Reservation
- 装置の予約(修正・取消) 14~17
Equipment Reservation (Revise and Cancel)
- 利用料金について 18
The Support Charge



ユーザー登録/User Registration

“info-arim@nims.go.jp”からのメールを受け取れるように設定してください。
Please make sure you can receive emails from “info-arim@nims.go.jp”.

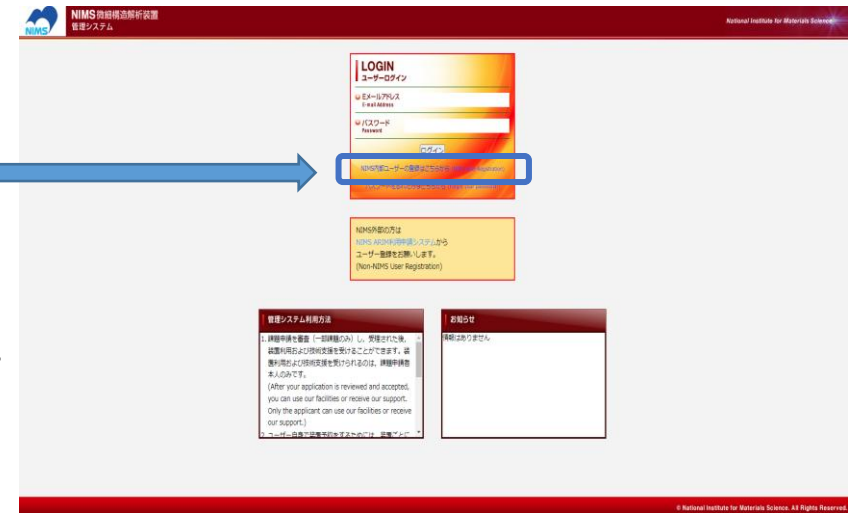
【URL】

<https://www.nmcp.jp/>

「NIMS内部ユーザーの登録はこちらから」をクリックします。
ユーザー登録済みの方はメールアドレス（大文字・小文字を区別します）とパスワードを入力してログインしてください。

Please click “NIMS User Registration”.

If you are a registered user, log in with your email address (case sensitive) and password.



ユーザー登録

NIMS 情報通信技術研究所共用装置管理システムをご利用いただくためのユーザー登録フォームです。
必要事項をご記入の上、ご登録ください。
※は必須入力項目になります。

暗号化について
このサイトは、ブラウザとサーバー間で情報の送受信が暗号化されています。左記の画像をクリックして詳細の内容をご確認ください。

職員番号
NIMS staff ID

パスワード
パスワード (再入力)

氏名
氏名 (カナ)

年齢層

ユーザー区分
User Classification

所属機関
Affiliated Institution

所属部署
Affiliated Department

役職
Job Position

所属機関郵便番号
Office Zip Code

所属機関住所
Office Address

電話番号
Telephone number

Eメールアドレス
E-mail address of your personal computer

居住者非居住者の別
Residential Status

雇用関係の有無
Presence of employment relationship

特定類型の該当
Categories

個人情報の取扱い
Handling of personal information

各項目に情報を入力して、「本システムのプライバシー保護に関する取り決めについて」を確認後「同意する」にチェックを付けます。
次へ→登録
Please agree after reading “The Rule of Privacy Protection of This System” regarding the handling of personal information
 agree with the handling of the privacy information.
Next→Submit

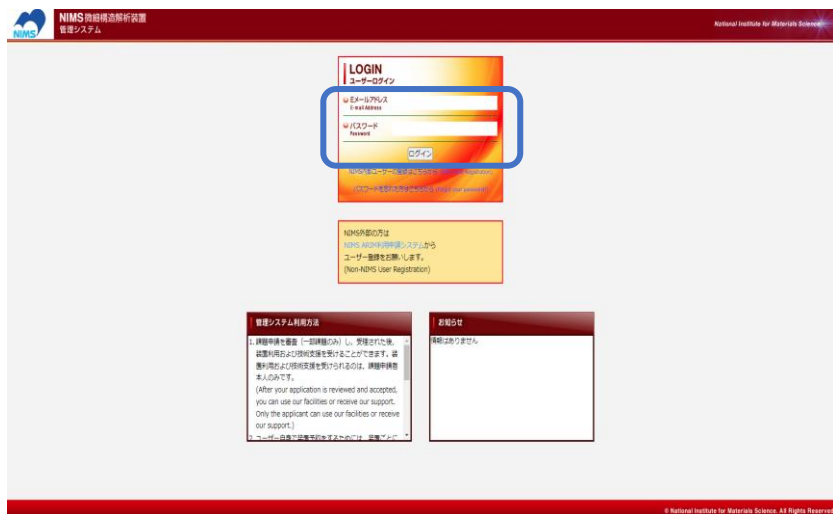
ユーザー登録が完了すると、
本登録のお知らせメールが届きます。
After user registration,
You will get a mail of completion.



【URL】

<https://www.nmcp.jp/>

登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
Please login with your user email address and password.



ユーザー本登録のお知らせ/Notification of user registration

ユーザー本登録のお知らせ

NIMS 共用装置管理システムよりお知らせいたします。

ユーザー登録の手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

ユーザーID： *****

ご登録いただいたメールアドレスとパスワードを使用してログインし、「新規利用申請」へ進んでください。

*パスワードはログイン後、ご自身で変更可能です。

NIMS 共用装置管理システムログインページ：<https://www.nmcp.jp/>

This is a message from NIMS microstructural characterization facility services system.
Your user registration has been completed.

User ID: *****

When you receive this registration notice, please log in with your email address and password, you can access "New Application".

You can change the password by yourself after you logged in.

【Registration System URL】<https://www.nmcp.jp/>

【ご注意】

本メールは送信専用となります。このメールへの返信はご遠慮ください。
お問合せは下記までお願いいたします。

[Notice]

Please do not reply to this e-mail.
If you have any inquiries, please contact us below.

利用申請(内部利用)/Application for use

利用申請・支援履歴より新規利用申請を行ってください。
Please apply from “Application for use/Support history” page.

📄 利用申請・支援履歴 - 一覧 Application for use / Support history (List)

2025年度 ▼ 表示する/Show

新規利用申請をクリック
Click 「New application」

新規利用申請/New application

※利用料金は税抜き表示(not including consumption tax)

2025年度/2025FY									
コード Code	管理ID Management ID	ユニット Unit	区分 Type	申請日 Application date	状態 Status	データ共有 Data Share	利用料金 Usage fee	最終利用日 The date of last use	修正 Revised
	支援課題名 A title of application		利用サイト Site use	申請者 Applicant			公開/非公開	支援日 The date of support	削除 Deleted

ユーザ さん

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

装置予約
Equipment reservation

課題別利用料金
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

利用申請・支援履歴 - 規約の承認 Application for use / Support history (Acceptance of the Terms)

利用規約 <small>General Conditions for Use of Equipment and Facilities</small>	各装置の利用ルールを順守してください。 Please obey the usage rule of each equipment.
注意事項 <small>Notice</small>	年度ごとに利用報告書の提出が義務付けられています。 It is required to submit the usage reports annually.
規約の承認 <small>Acceptance of The Terms</small>	<input type="checkbox"/> 利用規約を承認します。また、報告書の提出に同意します。 I approve the terms and agree to submit the report.
研究不正防止等に係る宣誓 <small>Promise never to do research misconduct</small>	<input type="checkbox"/> NIMSの定める規則、事項を遵守します。 I obey NIMS regulations and terms. <input type="checkbox"/> 研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサーシップ、二重投稿等）を行いません。 I will not do any research misconduct (fabrication, falsification, plagiarism, unapt authorship, and duplicate submission).

利用規約に同意し、利用を申し込む / I agree with above provisions, and would like to apply.

利用規約・注意事項の確認と承認をして、「利用規約に同意し、利用を申し込む」をクリック

After confirming the contents and approving, please click “I agree with above provisions, and would like to apply.”.

利用実績に基づく月毎（1ヶ月毎）の請求
Defferend Payment(Pay every month)

※内部課金の支払いルールに基づき、振替申請によりお支払いいただきます。

※Please pay by transfer application (振替申請) based on the payment regulations of the internal charge(内部課金).

支払い方法に同意する / I agree with above.

メッセージを読んで「支払方法に同意する」をクリック
Please read the message and click “I agree with above.”.

研究支援課題申請 Application of Research-Support Subject

申請年度 Application FY	2025
申請者 Applicant	User

申請年度を確認してください。
Please confirm application year, FY20**.

は必須項目 (means "required fields")

研究支援概要 Overview of Research Support

機器利用（自分で共用装置を操作）する装置を選択してください。技術代行のご依頼のみの場合は装置選択不要です。
Please select the equipment you wish to use as Common Use. (Equipment Operation by Users) If you are only requesting Technical Surrogate, there is no need to select equipment.

電子顕微鏡ユニット(Electron Microscopy Unit) ▼

千現Aサイト(SengenA Site)

- 深紫外レーザーアトムプローブ(Invivo6000) ※内部利用のみ
- 原子レベル元素分布・構造解析用透過電子顕微鏡(SpectraUltra) ※内部利用のみ
- 実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G)
- 実動環境対応型電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B)
- 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1&2)
- 200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100)
- Double-tilt bias and heating TEM holder (Lightning)
- Double-tilt LN2 cryo TEM holder (Gatan 636)
- Gatan Double Tilt Heating Holder Model 652
- 走査電子顕微鏡(JSM-7000F)
- デュアルビーム加工観察装置(NB5000)
- FIB/SEM精密微細加工装置(Helios 650)
- FIB加工装置(JIB-4000)
- FIB加工装置(JEM-9320FIB)
- ピックアップシステム(Pick-up System)
- ウルトラマイクロトーム(Leica EM UC6)
- HRTEM解析システム(HRTEM Analysis System)
- 電子線エネルギー分散型X線分析装置(EDS) ※内部利用のみ

<p>*支援課題名 Title of Research-Support Subject</p>	<p>現在の文字数[Current number of characters] 0 ※ 40字以内で記述してください。 * Please input 40 characters or less.</p>	<p>NIMSワークフローシステムで申請した課題名を入力してください。 Please fill in the title of your subject you applied from the NIMS Workflow System.</p>
<p>*研究概要 Overview of Your Research</p>	<p>現在の文字数[Current number of characters] 0 250文字以内をお願いします。 Please input 250 characters or less.</p>	
<p>*データ提供 Data share</p>	<p><input type="radio"/>提供あり(Yes) <input type="radio"/>提供なし(No)</p> <p>NIMS内部利用は原則【データ提供あり】となります。 RDEに対応した共用設備を利用する際には、RDEにデータを登録していただきます。 【データ提供なし】の利用料金は、データ提供ありよりも高額になります。 In principle, NIMS internal use is required to select 【With data sharing】 When using shared equipment that supports RDE, you will be required to register your data with RDE. The usage fee for 【No data sharing】 is higher than that for 【With data sharing】</p>	
<p>*NIMS ワークフローシステム課題番号 Applicant ID which was obtained from the NIMS Workflow System</p>	<p>25NM****</p>	<p>NIMSワークフローシステムで取得した課題番号を入力してください。 複数の課題番号を使い分けたい場合は、課題番号ごとに利用申請が必要です。 Please fill in your Application ID obtained from the NIMS Workflow System. If you wish to use more than one Application ID , you need to apply for each ID.</p>
<p>備考 Note</p>		
<p>利用責任者情報 Supervisor Information</p>		
<p>*利用責任者名 Supervisor Name</p>		
<p>*利用責任者Eメールアドレス Supervisor's E-mail Address</p>		

記入が完了したら、「入力内容を確認する(Confirm)」をクリックします。その後、「上記内容で申請する(Submit)」をクリックします。
After completing entry, click "Confirm". And then click "Submit".

申請を受け付けました。
Application has been accepted.

新規利用申請受付のお知らせメールを送信しました。
"Registration of use application" mail has been sent.

[Back to My Page](#)

申請を受け付けしました。
The application has been accepted.

装置の予約/Equipment Reservation

ライセンス所持者のみご自身で機器利用の予約が可能です。
Users have a license can make a reservation on your own.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課費申請・文書照会 Subject application / support history
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課費発生管理 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 03月 March, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) □ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																															
実動環境対応電子線木ログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																															
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Technai G2 F30)																															
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																															
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																															
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																															
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																															
FIB加工装置 (JIB-4000)																															
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																															
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																															
ピックアップシステム (Pick-up System)																															
デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)																															
TEM試料作製装置群 (TEM試料作製装置群)																															
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																															
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																															
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																															
冷却電界放出形ローレンツ電子顕微鏡																															

【予約方法/Reservation Method】
①はじめに、予約したい装置名(または日付)をクリックします。
First, please click an equipment(or date).

※グレーの箇所は他の予約があります。
Gray areas have other reservations.

- ユーザ temuser さん
- マイページ My Page
- 課題申請・支援履歴 Subject application / Support history
- 装置予約 Equipment reservation**
- 課題別利用料金 Support charge by each subject
- ログアウト Output Registration

装置予約 - 装置詳細 Equipment reservation (Equipment Details)

200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)		
前月へ Previous month	2018年 03月 March, 2018	次月へ Next month

日付をクリックして予約をしてください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	木												
2	金												
3	土												
4	日												
5	月												
6	火												
7	水												
8	木												
9	金												
10	土												
11	日												
12	月												
13	火												
14	水												
15	木												
16	金												
17	土												
18	日												
19	月												
20	火												
21	水												
22	木												
23	金												
24	土												
25	日												
26	月												
27	火												

②次に、予約したい日付(または装置)をクリックします。
Next, please click a date (or equipment).

※グレーになっている箇所は一部でも重複があると予約できません
黄色のラインは本日を意味します。

Gray cell has already been reserved. You can not make a reservation at the same time.
Yellow line shows today.

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

予約日 Day	2018-03-14	
開始時間～終了時間 Start ~ End	<input type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM	<input type="text" value="09:00"/> ~ <input type="text" value="10:00"/>
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)	
予約者 Subscriber	temuser	
利用者 User	temuser	
課題 Subject	<input type="text" value="課題を選択してください"/>	
利用形態 Use Style	機器利用	
コメント Comments	<input type="text"/>	

③利用時間を選択します。
Choose AM or PM or input the time

※装置により、セッション制もしくは時間単位で表示されます。

※Depending on the equipment, it is displayed either on a session or an hourly basis.

④課題を選択します。
Choose a subject

入力内容を確認する/Confirm

戻る/Back

⑤入力が完了したらこちらをクリック
Click here

【補足事項/Supplemental remarks】

* AM & PMで利用したい場合、両方にチェックを入れてください。

If you'd like to reserve both AM and PM, you need to check both.

* 必要に応じてコメント欄を活用ください。

Please use Comments if necessary.

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

▶ 装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

予約日 Day	2018-03-14
開始時間～終了時間 Start ~ End	09:00 ~ 12:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[ID-TEM-test1] 例) *****の観察
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

内容を確認後、
予約を確定します。
After confirmation,
finalize your reservation.

上記の内容で予約する / Set

予約日当日のキャンセル操作はできませんので、ご注意ください。

Please note that cancellations cannot be made on the day of use by yourself.

戻る / Back



- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

▶ 装置予約 - 新規登録 Equipment reservation (New Registration)

登録しました / Completed

トップへ戻る / Back to Top Page

予約の修正・取消/Revision & Cancellation

ユーザ temuser さん

マイページ
My Page

課題申請・支援履歴

**装置予約
Equipment reservation**

課料の明細を印刷
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

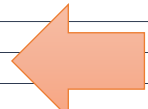
装置予約 Equipment reservation

前月へ Previous month 2018年 04月 April, 2018 次月へ Next month

予約したい装置もしくは日にちをクリックして下さい (Click the machine name or the date you want to book.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
実験環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)																														
実験環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)																														
300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Tecnai G2 F30)																														
300kV電界放出形電子顕微鏡 (JEM-3000F)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)																														
200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)																														
200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)																														
走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)																														
FIB加工装置 (JIB-4000)																														
FIB加工装置 (JEM-9320FIB)																														
FIB加工装置 (JEM-9310FIB1)																														
FIB加工装置 (JEM-9310FIB2)																														
ピックアップシステム (Pick-up System)																														
デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)																														
ウルトラマイクローム (Ultramicrotome)																														
HRTEM解析システム (HRTEM解析システム)																														
電子線トモグラフィー解析システム (電子線トモグラフィー解析システム)																														
イオンスライサー Ion Slicer (TEM試料作製装置群)																														
超深イオン研磨装置③ PIPS(Model 691) 103																														



①修正・取り消したい装置をクリックします。

Click an equipment which you would like to revise or cancel.

ユーザ

マイページ
My Page

利用申請・支援履歴
Application for use / Support history

装置予約
Equipment reservation

課題別利用料金
Support charge by each subject

ログアウト
Output Registration

前月へ Previous month

2022年 06月 June, 2022

次月へ Next month

日付をクリックして予約をしてください。(Click a date and make a reservation.)

■ : 本人の予約 (Your booking) ■ : 他人の予約 (Others)

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	水												
2	木												
3	金												
4	土												
5	日												
6	月												
7	火												
8	水												
9	木												
10	金												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	土												
12	日												
13	月												
14	火												
15	水												
16	木												
17	金												
18	土												
19	日												
20	月												
		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	火												
22	水												
23	木												
24	金												
25	土												
26	日												
27	月												
28	火												
29	水												
30	木												

②修正・取り消したい予約にカーソルを合わせてクリック。
Click the reservation you would like to revise or cancel.



装置予約状況ページへ戻る (Back to the booking status page.)

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 詳細 Equipment reservation (Details)

予約日 Day	2018-05-16
開始時間～終了時間 Start ~ End	13:00 ~ 16:30
装置名 Equipment	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)
予約者 Subscriber	temuser
利用者 User	temuser
課題 Subject	[] test課題
利用形態 Use Style	機器利用
コメント Comments	

予約日当日のキャンセル操作はできませんので、ご注意ください。
Please note that cancellations cannot be made on the day of use by yourself.

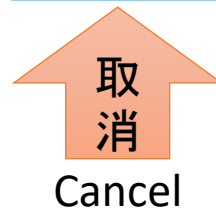
予約を修正する / Booking Change

予約を削除する / Booking Delete

戻る / Back



Revise



Cancel

③内容に間違いがないかを確認し、クリック。
Confirm all the contents and click "Revise" or "Cancel".

課題とコメントの修正が可能です。
時間の修正は時間制装置のみ操作可能です。
予約日の変更およびセッション制装置の予約変更は、
予約の取り直しをお願いします。
You can modify your subject and comments.
Only an hourly-basis equipment can be operated to modify the time.
If you wish to change your reservation date or a reservation for a
session-based equipment, please reschedule your reservation.

- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

装置名 (Equipment) : 【200kV電界放出形透過電子顕微鏡/JEM-2100F1】
予約時間 (Booking Time) : 【13:00~16:30】
を本当に削除しますか？

予約を削除する / Booking Delete

戻る / Back



- ユーザ temuser さん
- マイページ
My Page
- 課題申請・支援履歴
Subject application / Support history
- 装置予約
Equipment reservation**
- 課題別利用料金
Support charge by each subject
- ログアウト
Output Registration

装置予約 - 削除 Equipment reservation (Deletion)

削除しました

戻る

この画面になれば取消は完了です。

This page means "Cancellation Completed".

注：予約者本人によるキャンセル・変更は予約日の前日まで可能です。(※)

予約日当日のキャンセル・変更は各サイトスタッフと電子顕微鏡ユニット事務局(tem@nims.go.jp)にご連絡をお願いいたします。

使用開始時間の24時間前までのキャンセルは課金されませんが、それ以降のキャンセルは課金される場合がありますのでご了承ください。

※予約前日までキャンセル可能ではありますが、装置の利用効率化のため、予定が分かり次第、早めにキャンセルくださいますようお願いいたします。

Note: Users can cancel or reschedule their reservations up to one day prior to the reservation date. (※)

Please contact the person in charge and Electron Microscopy Unit office(tem@nims.go.jp) for cancellations or changes on the day of your reservation.

Cancellations made up to 24 hours prior to the start of use will not be charged, but cancellations made after that time may be charged.

※Although it is possible to cancel up to the day before the reservation, we ask for your cooperation in canceling as soon as you know your plans in order to make efficient use of the equipment.

利用料金について

The Support Charge

NIMS 微細構造解析装置 管理システム National Institute for Materials Science

ユーザー

- マイページ
My Page
- 利用申請・支援履歴
Application for use / Support history
- 装置予約
Equipment reservation
- 課題別利用料金
Support charge by each subject**
- 出力登録
Output Registration

課題別利用料金 Support charge by each subject

2022年度 ▼ 表示する / Show

2022年度 課題別利用料金一覧 [2022-06-15 現在] Total Usage Fees

コード Code	管理ID ▲ Management ID		支援課題名 A title of subject										申請者 Applicant			データ共有
	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	1月 January	2月 February	3月 March	合計 Total			
1817	テスト													なし		
	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0		¥0	
		印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	¥0		
1905	テスト													なし		
	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0		¥0	
		印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	印刷 Print	¥0		

2022年度3月 電子顕微鏡導入アクション 利用明細書

項目	単位	数量	単価	金額	税率	消費税	合計
3000円	6000円	1	3000円	3000円	0%	0円	3000円
請求金額						3,300円	

このページで月ごとおよび年度合計の利用料金を見ることが出来ます。「印刷」をクリックすると利用明細書が表示されます。
※NOF利用、内部利用「SpectraUltra アドバンス利用」および「JEM-ARM300F アドバンス利用」の料金計算には対応していません。

You can see the your monthly and yearly total charges on this page.
If you click the print button, you can view the statement.
※Fee calculations for NOF use and internal use 「 SpectraUltra Advance use 」 and 「JEM-ARM300F Advance use」 are not supported.